EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05291621

PUBLICATION DATE

05-11-93

APPLICATION DATE

10-04-92

APPLICATION NUMBER

04118227

APPLICANT: NICHIA CHEM IND LTD;

INVENTOR:

NAKAMURA SHUJI:

INT.CL.

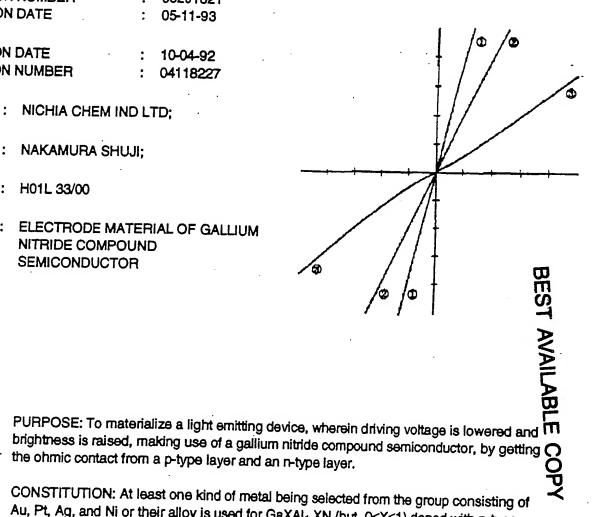
H01L 33/00

TITLE

: ELECTRODE MATERIAL OF GALLIUM

NITRIDE COMPOUND

SEMICONDUCTOR



ABSTRACT:

CONSTITUTION: At least one kind of metal being selected from the group consisting of Au, Pt, Ag, and Ni or their alloy is used for GaXAI₁.XN (but, 0≤X≤1) doped with p-type impurities, and at least one kind of metal being selected from the group consisting of Al,

Cr, Ti, and In or their alloy is used for GaXAI₁.XN doped with n-type impurities.

COPYRIGHT: (C) JPO

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出額公開番号

特開平5-291621

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51) Int.Cl.5

HOIL 33/00

識別記号

庁内整理番号

E 8931-1M

C 8934-4M

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21)出願番号

特爾平4-118227

(22) 出願日

平成4年(1992)4月10日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 妹尾 雅之

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

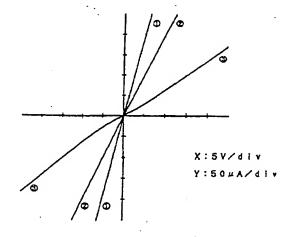
学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 空化ガリウム系化合物半導体の電板材料

(57)【要約】

【目的】 p型層およびn型層からオーミック接触を得ることにより、空化ガリウム系化合物半導体を利用して、低駆動電圧化、高輝度化した発光デバイスと実現する。

【構成】 p型不純物をドープしたG a i A I_{i-1} N i N i N i L i りなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの台金を使用し、また i 型不純物をドープしたG a i A i i N i には A i N i C i N i N i D i N



(2)

特開平5-291621

【特許請求の範囲】

【請求項1】 p型不純物をドープした一般式GarA $I_{1:1}N$ (但 $0 \le X \le 1$) で表される空化ガリウム系化合物半導体とオーミック接触を得る電極材料として、Au、Pt. Ag. Nl よりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用することを特徴とする空化ガリウム系化合物半導体の電極材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は紫外、育色発光ダイオード、レーザーダイオード等に使用される窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料に係り、特にオーミック接触を得ることのできる電極材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】紫外、青色発光ダイオード、レーザーダイオード等の発光デバイスの材料として、一般式がGaiAlinN(0.≤ X≤1)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が知られている。しかし、空化ガリウム系化合物半導体の物性については、未だよく解明されておらず、窒化ガリウム系化合物半導体のp型層、およびn型層とオーミック接触を得ることのできる電極材料もよく知られていないのが実状である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そのため、室化ガリウ 30 ム系化合物半導体を利用して、低駆動電圧化、高輝度化した発光デバイスと実現するには、p型層およびn型層からオーミック接触を得ることが不可欠である。

【0004】本発明はこのような事情を鑑み成されたもので、窒化ガリウム系化台物半導体のp型解およびn型層からオーミック接触の得られる電極材料を提供して、高輝度化、低電圧駆動化できる発光デバイスを実現するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らはMOCVD 40 法を用い、サファイア基板上にSiをドープした n型G aiAli-iNと、Mgをドープした p型G aiAli-iNには電子線を照射、または500℃以上にアニーリングしてさらに低抵抗な p型とした後、n型及び p型G aiAli-iNに数十種類の電極材料を蒸着して、オーミック接触の確認を取ったところ、特定の金属、またはそれらの合金に対してのみ良好なオーミック接触が得られることを発見し、本発明を成すに至った。

【0006】即ち、本発明の窒化ガリウム系化合物半導 50 の利用価値は多大である。

体の電板材料は、p型不純物をドープした室化ガリウム 系化合物半導体にはAu、Pt、Ag、NIよりなる群 から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの 合金を使用することを特徴とするものであり、また、n 型不純物をドープした窒化ガリウム系化合物半導体に は、Al、Cr、Ti、Inよりなる群から選択される 少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用する ことを特徴とするものである。

[0007]

【実施例】図1にp型GarAli-rNに電極を蒸着し、その電流電圧特性を測定してオーミック接触を調べた結果を示す。①はPt電極単独、②はNiをベースとし、その上にAuを設けた電極、③はAu電極単独である。また、いうまでもなくNI電極単独またはNiをベースとしその上にPt、Agを設けた場合は②と同一の直線となる。

【0008】この図に示すようにいずれの電板材料でもp型層に対しオーミック接触が得られるが、特に好ましい電板材料として①Pt、②Niベースの電板を挙げることができる。特にNiをペースとすることにより、例えば、p型GaiAl:-iNに対しアニーリング等の熱処理を行った場合、Au電板単独であれば利がれ落ちてしまう欠点があるが、アニーリングの熱にも耐えることができ、強弱に電極を付着させることができる。蒸着する好ましいNiの厚さは0.01μm~0.5μmである。それらの範囲で電極を形成することにより、剥がれ落ちにくく、良好なオーミック接触が得られる。

【0009】図2にn型GarAlinnNに同じく電極を蒸着し、その電流電圧特性を測定してオーミック接触を調べた結果を示す。④はCrをペースとし、その上にAlを設けた電板、⑤はAl電極単独、⑥はTl電極単独である。Cr電極単独またはCrをペースとしその上にTl.Inを設けた場合は②と同一の直線となる。

【0010】この図に示すようにいずれの電極材料でも n型層に対しオーミック接触が得られるが、特に好ましい電極材料として④Crベースの電板、⑤AI電板を挙 げることができる。

【0011】窒化ガリウム系化合物半導体に不純物をドープしてp型にし得る不純物としては例えばMg、2n、Cd、Be、Ca等を用いることができ、またn型にし得る不純物としてはSi、Sn、Ge等を用いることができる。

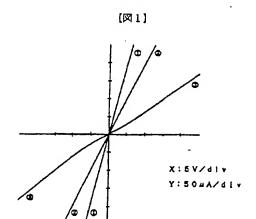
[0012]

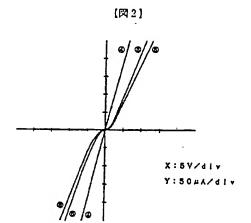
【発明の効果】以上説明したように本発明の電極材料によると、好ましくp型及びn型GarAli-iNとオーミック接触が得られるため、GarAli-iNを利用した発光ダイオード、レーザーダイオード等の研発に向けてその利用価値は多大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 電極を蒸着したp型GarAli-rNの電流電圧特性を示す図。

【図2】 電極を蒸着したn型GarAli-iNの電流電圧特性を示す図。





BEST AVAILABLE COPY